

- [4] Cazaux J., Etienne P., Razeghi M. // J. Appl. Phys. 1986. Vol. 59. N 10. P. 3598—3601.  
[5] Андреев В. М., Богданович М. С., Гореленок А. Т. и др. // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 8. С. 1566—1569.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
15 декабря 1989 г.

02; 11

Журнал технической физики, т. 60, в. 10, 1990

© 1990 г.

## ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА

A. A. Кургузов, O. I. Семенов

При термической десорбции и рассеянии атомов щелочных металлов на металлической поверхности с большой вероятностью идет процесс поверхностной ионизации. Вероятность этого процесса по экспериментальным данным [1, 2] зависит от энергетической разности между работой выхода материала мишени и энергией ионизации основного состояния отлетающей от поверхности атомной частицы, температуры поверхности и угла падения ионов на поверхность.

Существующие модели [1, 3] описывают отдельные детали процесса ионизации для случая термической десорбции и выведены в приближении существования термодинамического равновесия в системе отлетающая частица—поверхность. Однако в случае скоростей отлета атомных частиц, существенно превышающих тепловые, время взаимодействия частицы становится значительно меньшим времени установления термодинамического равновесия и исходные положения указанных моделей не выполняются. Вместе с тем этот диапазон скоростей соответствует режимам работы ионных источников, плазменных ускорителей и многих других физических приборов, в работе которых процесс ионизации атомов может играть существенную роль.

Рассмотрим этот процесс, используя метод вторичного квантования. При взаимодействии атомной частицы с поверхностью ее энергетические уровни сдвигаются и уширяются в результате взаимодействия с электронами в приповерхностной зоне. В работе [4] было показано, что при приближении частицы к поверхности изменение энергии связанных состояний может быть значительным. Экранирование приводит к тому, что связанные состояния выходят в континuum, и на расстояниях порядка нескольких атомных единиц от поверхности может существовать только основное состояние с пониженной энергией ионизации. Это позволяет свести гамильтониан взаимодействия атомной частицы с поверхностью к виду [5]

$$H(t) = \sum_k \epsilon_k n_k(t) + \epsilon_a(t) n_a(t) + \sum_k [V_k(t) c_a^+(t) c_k(t) + \text{с. с.}],$$

где  $\epsilon_k$  — энергия  $k$ -уровня поверхности металла;  $\epsilon_a$  — энергия основного состояния атома;  $c_a^+$ ,  $c_a$ ,  $c_k^+$ ,  $c_k$  — операторы «рождения» и «уничтожения» электрона в состояниях  $a$  и  $k$  соответственно;  $V_k$  — матричный элемент оператора взаимодействия;  $n = \langle c^+ c \rangle$  — число заполнения состояний.

Вероятность ионизации будет

$$P = 1 - n_a(\infty).$$

Следуя работе [5], запишем уравнения движения для операторов  $c_a$  и  $c_k$

$$\frac{\partial c_a}{\partial t} = i [H(t), c_a(t)], \quad \frac{\partial c_k}{\partial t} = i [H(t), c_k(t)]. \quad (1)$$

Решая систему дифференциальных уравнений (1) и вводя ширину атомного уровня, взаимодействующего с поверхностью в виде

$$\Delta(t) = \pi \sum_k |V_k(t)|^2 \delta(\epsilon_a - \epsilon_k),$$

получим уравнение для числа заполнения основного состояния атома

$$n_a(\infty) = \pi^{-1} v^{-2} \int d\varepsilon \mathcal{F}(\varepsilon, T) \left| \int_0^\infty e^{-i\varepsilon r/v} g(r) dr \right|^2,$$

$$g(r) = \Delta^{1/2}(r) \exp \left( -1/v \int_r^\infty [\varepsilon_a(r') + \Delta(r')] dr' \right), \quad (2)$$

где  $v$  — проекция скорости отлета атомной частицы на нормаль к поверхности;  $\mathcal{F}(\varepsilon, T)$  — функция распределения Ферми.

Зависимость ширины основного состояния можно приближенно представить в виде [5]

$$\Delta(r) \approx \Delta_0 \exp(-2\alpha r),$$

где  $\Delta_0$  и  $\alpha$  — некоторые параметры ( $\Delta_0 \approx 10$  а. е.,  $\alpha \approx 1$  а. е.).

В работе [6] на основании формулы (2) получено выражение

$$n_a(\infty) = 1/\pi \Phi(x) \left\{ \arctg \frac{\varepsilon_F - \varepsilon_a}{av} + \arctg \frac{\varepsilon_a}{av} - \frac{(\pi kT)^2}{3} \frac{(\varepsilon_F - \varepsilon_a) av}{[(av)^2 + (\varepsilon_F - \varepsilon_a)^2]^2} \right\}, \quad (3)$$

где  $\Phi(x)$  — интеграл вероятности,  $x = (\Delta_0/(2\alpha v))^{1/2}$ ,  $T$  — температура поверхности,  $k$  — постоянная Больцмана,  $\varepsilon_F$  — энергия уровня Ферми.

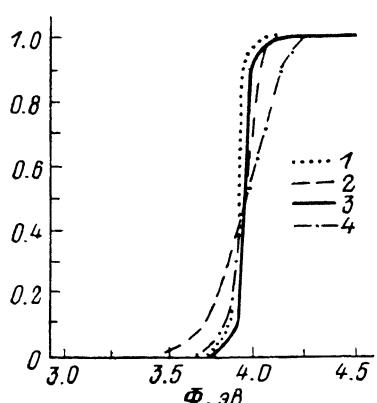
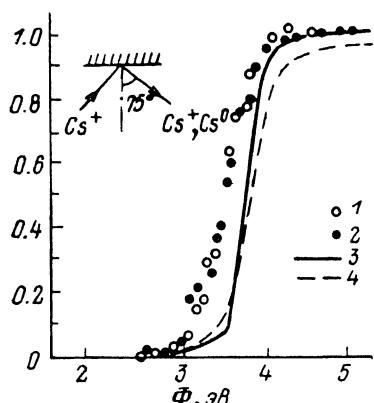


Рис. 1. Выход ионов  $Cs^+$  при изменении работы выхода  $\Phi$  для разных энергий бомбардировки. 1, 3 — 500; 2, 4 — 2000 эВ; 1, 2 — [2]; 3, 4 — (8);  $\alpha=0.5$ .

Рис. 2. Выход ионов  $Cs^+$  с изменением работы выхода при различных температурах поверхности  $T$ . 1, 3 — 300; 2, 4 — 1000 К; 1, 2 — [2]; 3, 4 — (8);  $\alpha=0.5$ ,  $E=1$  эВ.

В эксперименте [2] исследовался зарядовый обмен при бомбардировке поверхности W (110), покрытой цезием. Работа выхода поверхности менялась посредством изменения толщины покрытия. Результаты расчета по формуле (3) и данные [2] приведены на рис. 1. На рис. 2 проводится сравнение расчета по формуле (3) и термодинамического расчета [3] в случае тепловых энергий при различных температурах поверхности. В обоих случаях наблюдается эффект «прорисовывания» зоны проводимости, так что вероятность нейтрализации мала, если потенциал ионизации атома меньше работы выхода поверхности и близка к 1 в противоположном случае. Наблюдается хорошее согласие расчетов по формуле (3) с экспериментом при средних энергиях атомных частиц и с термодинамическим расчетом в случае тепловых энергий.

#### Список литературы

- [1] Зандберг Э. Я., Ионов Н. И. Поверхностная ионизация. М.: Наука, 1960. 432 с.
- [2] Van Amersfort P. W., Geerlings J. J. C., Kwakman L. F. Tz. et al. // J. Appl. Phys. 1985. Vol. 58. P. 2312–2316.
- [3] Taylor J. B., Langmuir I. // Phys. Rev. 1933. Vol. 44. P. 423.
- [4] Кургузов А. А., Хахаев А. Д. // Корреляционные и релятивистские эффекты в атомах и ионах. М.: Наука, 1985. С. 95.

[5] Brako R., Newns D. M. // Surf. Sci. 1981. Vol. 108. N 3. P. 253.

[6] Кургузов А. А., Семенов О. И. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1989. № 3. С. 39—43.

Петрозаводский государственный  
университет им. О. В. Куусинена

Поступило в Редакцию  
7 декабря 1989 г.  
В окончательной редакции  
15 мая 1990 г.

07; 12

Журнал технической физики, т. 60, в. 10, 1990

© 1990 г.

## ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ И АМПЛИТУДЫ ВИБРАЦИЙ ТЕЛА МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

Л. М. Веселов, И. А. Попов

В настоящей работе исследуются статистические характеристики когерентного излучения, рассеянного на шероховатой поверхности, применительно к задаче неконтактного определения частоты и амплитуды вибраций тела. Ранее статистика рассеянного когерентного излучения при движении рассеивающей поверхности исследовалась лишь при прямолинейном перемещении или вращении (см., например, [1, 2]); случай колебательного движения или движения с переменной скоростью, насколько нам известно, не анализировался.

Рассмотрим плоскую шероховатую поверхность, колеблющуюся в своей плоскости по закону  $h = h_0 \sin \omega t$ , где  $h_0$  — амплитуда смещения,  $\omega$  — частота колебания. Условия освещения и наблюдения таковы, что угол падения на поверхность когерентного гауссова пучка и угол наблюдения близки к нормальному. Предполагая, что выполнены условия формирования нормально развитой спектральной картины [3], и используя подход, изложенный в работе [2], для временной корреляционной функции флуктуаций интенсивности рассеянного излучения во френелевой зоне несложно получить

$$C_I(t_1, t_2) = k \exp [-\alpha (\sin \omega t_1 - \sin \omega t_2)^2], \quad (1)$$

где

$$\alpha = \frac{h_0^2}{w^2} \left[ 1 + \frac{4\pi^2 w^4}{\lambda^2} \left( \frac{1}{\rho} + \frac{1}{l} \right)^2 \right], \quad (2)$$

$w$  — радиус гауссова пучка на рассеивающей поверхности по уровню поля  $e^{-1}$ ,  $\lambda$  — длина волн,  $\rho$  — радиус кривизны волнового фронта,  $l$  — расстояние от поверхности до точки наблюдения,  $k$  — постоянная.

Корреляционная функция (1) зависит от двух переменных  $(t_1, t_2)$ , причем эта зависимость не сводится к зависимости от их разности, что связано с очевидной нестационарностью процесса рассеяния при колебательном движении шероховатой поверхности (рис. 1). По каждой переменной  $(t_1, t_2)$  корреляционная функция имеет периодический вид, обусловленный периодичностью движения рассеивающей поверхности: в каждый период колебания пучком света освещаются одни и те же участки рассеивателя.

Отметим, что экспериментальное определение двумерной корреляционной функции (1) — довольно трудоемкая задача, поэтому более предпочтительным является измерение спектральной плотности случайного процесса. Вследствие периодичности спектр мощности должен иметь линейчатую структуру с расстоянием между компонентами, равным частоте колебаний тела.

Используя обобщенную теорему Винера—Хинчина [4], для амплитуды  $n$ -й гармоники спектра мощности флуктуаций интенсивности излучения получим

$$b_n = \left( \frac{\omega}{2\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi/\omega} \int_0^{2\pi/\omega} C_I(t_1, t_2) \exp [-i n \omega (t_1 + t_2)] dt_1 dt_2. \quad (3)$$

В зависимости от амплитуды колебаний, параметров освещения и наблюдения величина  $a$ , определяемая соотношением (2), может принимать значения  $10—10^6$ . При  $a \gg 1$  (прак-